(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-147528 (P2000-147528A)

(43)公開日 平成12年5月26日(2000.5.26)

(51) Int.Cl.7		機別記号	FΙ			テーマコード(参考)
G02F	1/1339	505	G 0 2 F	1/1339	505	2H088
	1/13	101		1/13	101	2H089

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 7 頁)

(22)出顕日 平成10年11月16日(1998.11.16) 松下電器産業株式会社 大阪前門真市大字門真100番地 (72)発明者 江上 典彦 大阪前門真市大字門真100番地 松 産業株式会社内 (72)発明者 外國 信責 大阪前門真市大字門真100番地 松 産業株式会社内 (74)代理人 100080827				
(22) 出願日 平成10年11月16日(1998.11.16) 大阪府門真市大字門真1006番地 江上 與節 大阪府門真市大字門真1006番地 松 藍葉珠式会址内 (72) 発明者 外國 信貴 大阪府門真市大字門真1006番地 松 藍葉珠式会址内 (74) 代理人 100080827	(21)出願番号	特願平10-324605	(71)出願人	
(72) 発明者 江上 典彦 大阪府門真市大字門真1008 港地 松				
大阪府門真市大学門真1006番地 松	(22)出願日	平成10年11月16日(1998.11.16)		
產業株式会社内 (72)発明者 外國 信貴 大阪府門漢市大字門真1006楽地 松 產業株式会社内 (74)代理人 100080827			(72)発明者	江上 典彦
(72) 発明者 外國 信責 大阪府門其市大学門真1008 奉地 松 産業株式会社内 (74) 代理人 100080827				大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
大阪村門真市大字門真1008				産業株式会社内
大阪村門真市大字門真1008			(72) 登明者	外層 信告
產業株式会社内 (74)代理人 10080827			(10/70/21)	
(74)代理人 100080827				
			(m.c) (n.m.)	
			(74)代理人	
ガ佳上 有原 <i>時</i>				弁理士 石原 鹏

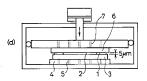
最終頁に続く

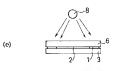
(54) 【発明の名称】 液晶表示素子の製造方法

(57)【要約】

【課題】 下基板と上基板の貼り合わせ時の位置すれを 無くし、画像むら不良を無くすことができる液晶表示素 子の製造方法を提供する。

【解決手段】 上面に禁密制」が弦布を北流品材料2が 油下された下基板3を真空容器C内に配置して下側の全 面を吸蓄機構5にて真空破影して固定し、下基板3に対 向するように所定の間隔で上基板6を配置して上側の全 面を吸蓄機材でて真空吸密して固定し、両方又は一方 の茎板3、6を接近移動させて上茎板6と流品材料2又 は接着削1を接触させた機、両基板3、6を基板面方向 に相対移動させて位置合わせを行い、その後両方又は一 方の基板3、6を接近移動させて相互に加圧し、両基板 3、6を貼り合わせる。





【特許請求の範囲】

【請求項 1】 上面に接着初が途布され液晶材料が流下 された下蒸板を真空容器的に配置して下側の全面を真空 吸着して固定し、下蒸板に対向するように貯定の削隔で 上基板を配置して上側の全面を真空吸着して固定し、両 方 スは一力の蒸板を接近移動させて上基板と流晶材料ス は接着耐を接触させた後、両基板を基板面方に相対移 動きせて位置合わせを行い、その後両方 スは一方の基板 を接近形動させて相互に加圧し、両基板を貼り合わせる ことを特徴とする液晶表示系での製造方法。

1

ここで有限ようの流転の水ボアン契息の方法。 (清決項2) 上面に接着初沙産市され流品材料が落下 された下基板を東室容器内に配置しその下側の全面を真 空吸着して固定し、下基板に対向するように所定の間隔 で上基板を配置しその上側の全面を真空吸着して固定 し、両方又は一方の基板を所置四隔位置で存扱び移動さ せ、再越板を基度取力向に国界が動きせて子価位置合か せを行い、その検両方又は一方の基板を接近移動させて 上基板と流品材料又は接着耐を接触させた後、両基板を 素板面方向に関射を動きせて温度合かせを行い、その検 両方又は一方の基板を接近移動きせて相互に加圧し、両 a基板を貼り合わせることを特徴とする流晶表示素子の製 造方法。

【請求項3】 上基板と液晶材料又は接着剤を接触させる工程時に、上基板を接着剤との間に敵小碗間が生じる 位置に維持することを特徴とする請求項1又は2記載の 効品表示業子の製造方法。

【請求項4】 下基板と真空吸着する機構との間に弾性 体を介装することを特徴とする請求項1又は2記載の液 品表示素子の製造方法。

【請求項5】 下基板と上基板を貼り合わせた後、下基 30 板の吸着を解除することを特徴とする請求項4記載の液 品表示素子の製造方法。

【請求項6】 下基板と上基板を貼り合わせた後下基板 の吸着を解除し、真空容額内の圧力を大気開放した後、 UV硬化接着剤により仮止めを行うことを特徴とする請 求項1 X は 2 に計載の済乱表示差子の製造方法。

【請求項7】 下基板と上基板を貼り合わせ、UV硬化 接着剤により仮止めを行った後、下基板の吸着を解除 し、真空容器内の圧力を大気開放することを特徴とする 請求項1又は2記載の流晶表示素子の製造方法。 【請求項8】 上来版と下半版のかなくとも一ちの位置

【請求項8】 上基板と下基板の少なくとも一方の位置 を規制機構にて規制することを特徴とする請求項1又は 2記載の商品表示素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、パーソナルコンピュータやTV受像機等の画像表示パネルとして用いられる液晶表示素子の製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来の液晶表示素子の製造方法につい

て、図5~図8を参照して説明する。

【0003】流晶表示素子の構造は、図5に示すよう に、対向配置された透光性材料からなる下蒸度11と上 基板12との間に一定のギャンでを保つととしての間 の空間に流晶材料15を充填した状態で両者が紫外線硬 化型の接着剤13にて貼り合わされている。接着剤13 には下蒸板11と上蒸板12の間隔を一定に保つための スペーサ14(径5μm)が含まれている。

【0004】このように流品材料15を接着剤13の内 側に配置する一方法として、図6に示すように、下基板 11に接着剤13を厚み30μmで統市した後(工程 a)、接着剤13の内側に流品材料15を流下して1程 b)、次に上基板12を24かわせて上基板12と下基 板11の間隔が5μmになるまで加圧して1程と)、そ の発熱外線16により接着剤13を硬化させて流晶表示 季子を完成とせる溶品流下上法が5る。

【0005】以下、上記2枚の基板の貼り合わせ方法に ついて、図7、図8を参照して詳しく説明する。

【0006】まず、表面に厚み30μmで結合された集や終戦化型の影響利3万及びその接着列13万の側に液 外線戦化型の影響列13万以での接着列130の側に液 前材料15分配置された下差板11を、水平均向に移動 可能なデーブル17上に搭載し、その下側の全面を吸着 機構18による反撃吸管で固定する「江程10、次に、 下基板11に対向するように所定の間隔で上差板12を 配置してその上側の全面を吸速機構19による真空吸着 で固定する(工程10、大線15年以上差板12を下させて 上基板12と下基板11の間隔を11年によりで変容器 でを開ける(工程10、次に、下基板11と指数したと ブル17を水平移動して、下基板11と上差板12と

の位置合かせを行うとともに、東空容器で内の原空引きを行う(工程4)。次に、上巻取12を降下させて上差 板12と液晶材料15以は接着剂13と按値させ、さらに下巻板11との間部が5以而になるまで加圧し、上差 板12を接着剤13を分に下巻板11に貼り合かせる(工程e)。その後、紫外條16を照射して探索剤13を便低させ(工程)、下基板11と上基板12の貼り合わせが戻する。

[0007]

(発明が解決しようとする課題)しかしながら、このよ 40 うな純米の方法では上基板12と下基板11の間隔を1 mmにして位置合わせを行い、その後上基板12を1m m降下させて上基板12を流結材料15と接着利13に 接触させ、さらに上基板12を乗直方向に加圧して貼り 合いも電影が、その降下、加圧時に位置すれが発生する という問題があった。

【0008】本発明は、上記従来の問題点に鑑み、下基 板と上基板の貼り合かせ時の位置すれを無くし、画像む の不良を無くすことができる液晶表示素子の製造方法を 提供することを目的とする。

50 [0009]

3

【課題を解決するための手段】本発明の液晶表示素子の 製造方法は、上面に接着剤が塗布され液晶材料が滴下さ れた下基板を真空容器内に配置して下側の全面を真空吸 着して固定し、下基板に対向するように所定の間隔で上 基板を配置して上側の全面を真空吸着して固定し、両方 又は一方の基板を接近移動させて上基板と液晶材料又は 接着剤を接触させた後、両基板を基板面方向に相対移動 させて位置合わせを行い、その後両方又は一方の基板を 接近移動させて相互に加圧し、両基板を貼り合わせるも のであり、上基板と液晶材料又は接着剤を接触させた後 10 方向に移動可能なテーブル4上に搭載し、下基板3の下 位置合わせを行うため、位置合わせ後の移動時の状態変 化が少なくかつ移動距離が短いため、下基板と上基板の 貼り合わせ時の位置ずれを無くして画像むら不良を無く すことができる。

【0010】また、上面に接着剤が塗布され液晶材料が 滴下された下基板を真空容器内に配置しその下側の全面 を真空吸着して固定し、下基板に対向するように所定の 間隔で上基板を配置しその上側の全面を真空吸着して固 定し、両方又は一方の基板を所定間隔位置まで接近移動 させ、両基板を基板面方向に相対移動させて予備位置合 20 わせを行い、その後両方又は一方の基板を接近移動させ て上基板と液晶材料又は接着剤を接触させた後、両基板 を基板面方向に相対移動させて位置合わせを行い、その 後面方又は一方の基板を接近移動させて相互に加圧し、 両基板を貼り合わせるものであり、同様に下基板と上基 板の貼り合わせ時の位置ずれを無くすことができて画像 むら不良を無くすことができるとともに、予備位置決め によって位置決め時の移動量が少なくなるため接着剤の 液晶材料への溶け込みを抑制できる。

【0011】また、上基板と液晶材料又は接着剤を接触 30 させる工程時に、上基板を接着剤との間に微小隙間が生 じる位置に維持すると、接着剤にて上基板と下基板がく っついてしまって位置合わせができなくなる恐れを無く すことができる。

【0012】また、下基板と真空吸着する機構との間に 弾件体を介装すると 下基板が上基板の形状にならって 上基板と下基板のギャップを高精度に得ることができ る。また、その場合に下基板と上基板を貼り合わせた 後、下基板の吸着を解除すると、上基板の吸着機構に両 基板が固定されることにより、両基板の平面度を高精度 40 に得ることができる。

【0013】また、下基板と上基板を貼り合わせた後下 基板の吸着を解除し、真空容器内の圧力を大気開放した 後、UV硬化接着剤により仮止めを行うと、貼り合わせ 後上基板と下基板がずれるのを確実に防止できる。

【0014】また、下基板と上基板を貼り合わせ、UV 硬化接着剤により仮止めを行った後、下基板の吸着を解 除し、真空容器内の圧力を大気開放すると、貼り合わせ 後上基板と下基板がずれるのを確実に防止できる。

【0015】また、上基板と下基板の少なくとも一方の 50 【0025】次に、吸着機構7を垂直方向に下降させ

位置を規制機構にて規制すると、上基板又は下基板の固 定を確実なものにできる。

[0016]

a) .

【発明の実施の形態】以下、本発明の液晶表示素子の製 造方法の第1の実施形態を図1、図2を参照して説明す 3.

【0017】まず、表面に厚み30 mmで塗布された紫 外線硬化型の接着剤1及びその接着剤1の内側に液晶材 料2が配置された透光性材料からなる下基板3を、水平 側の全面を吸着機構5による真空吸着で固定する(工程

【0018】次に、透光性材料からなる上基板6の上側 の全面を吸着機構7による真空吸着で固定し、真空容器 Cを閉じて真空引きを行い、吸着機構7を垂直方向に下 隆させて、上基板6と液晶材料2または接着剤1を接触 させる(工程b)。次に、下基板3を搭載したテーブル 4を水平方向に移動させて、下基板3と上基板6との位 置合わせを行う(工程で).

【0019】次に、吸着機構7を垂直方向に下降させ て、上基板6を接着剤1を介して下基板3に貼り合わ せ、5 µmまで加圧する(工程d)。その後、真空容器 Cから出し、紫外線8を照射して接着削1を硬化させ て、下基板3と上基板6の貼り合わせは完了する(工程 e).

【0020】この方法によれば、対向する位置に配置さ れた2枚の基板3、6の位置合わせ精度を1 mm以下に 抑制でき、画像むらを無くすことができる。

【0021】また、工程dでの加圧するまでの厚さは、 接着削1に含まれているスペーサの径に応じて変更して

【0022】次に、本発明の液晶表示素子の製造方法の 第2の実施形態を図3、図4を参照して説明する。

【0023】まず、表面に厚み30μmで塗布された紫 外線硬化型の接着剤1及びその接着剤1の内側に液晶材 料2が配置された淡光性材料からなる下基板3を、水平 方向に移動可能なテーブル4上に搭載し、下基板3の下 側の全面を吸着機構5による真空吸着で固定する(工程

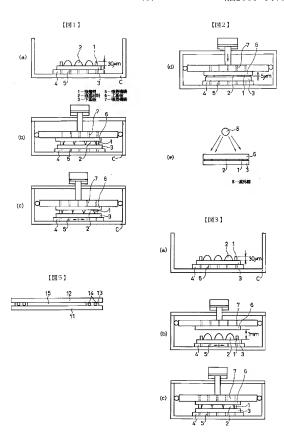
【0024】次に、透光性材料からなる上基板6の上側 の全面を吸着機構7による直空吸着で固定し、直空容器 Cを閉じて真空引きを行い、上基板6を降下させて下基 板3と上基板6の間隔を1mmにし、下基板3を搭載し たテーブル4を水平移動させて下基板3と上基板6の予 備の位置合わせをする(工程b)。次に、吸着機構7を 垂直方向に下降させて、上基板6と液晶材料2または接 着剤1を接触させる(工程で)。次に、下基板3を搭載 したテーブル4を水平方向に移動させて、下基板3と上 基板6の位置合わせを行う(工程d)。

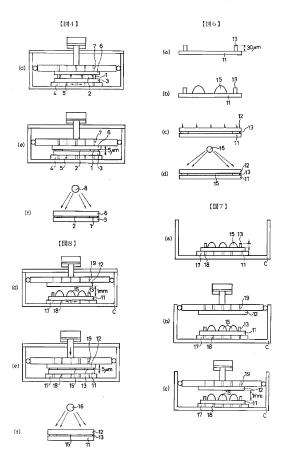
- て、上基板6を接着剤1を介して下基板3に貼り合わ せ、5 µmまで加圧する(工程e)。その後、真空容器 Cから出し、紫外線8を照射して接着剤1を硬化させ て、下基板3と上基板6の貼り合わせは完了する(工程 f).
- 【0026】この方法によれば、対向する位置に配置さ れた2枚の基板3、6の位置合わせ精度を1μm以下に 抑制でき、画像むらを無くすことができる。特に、予備 の位置合わせを行っているので、位置合わせ時の下基板 3の移動量が少なくなるため、移動による接着剤1の液 10 上基板と下基板のギャップを高精度に得ることができ、 品材料2への溶け込みをより一層抑制することができ
- 【0027】また、T程eでの加圧するまでの厚さは、 接着到1に含まれているスペーサの径に応じて変更して もよい。
- 【0028】また、下基板3と上基板6が接着剤1でく っついてしまって位置合わせができなくなるのを防止す るため、上基板6と液晶材料2又は接着剤1を接触させ る工程で液晶材料2にのみ接触させるように、上基板6 と下基板3の隙間を接着剤1の高さから100μmに維 20 持する機構を有してもよい。
- 【0029】また、上基板6と下基板3のギャップを高 精度に得るため、下基板3と吸着機構5の間に弾性体を 介装してもよい。

 弾性体を有する場合。

 貼り合わせ後の 上基板6と下基板3の平面度を高精度に得るため、下基 板3と上基板6を貼り合わせた後、下基板3の吸着を解 除し、上基板6の吸着機構7による吸着で固定するのが 好ましい。
- 【0030】また、貼り合わせた後上基板6と下基板3 合わせた後、下基板3の吸着を解除し、上基板6の吸着 機構7による真空吸着で固定し、真空容器C内の圧力を 大気開放した後UV硬化接着剤により仮止めを行っても
- 【0031】また、下基板3と上基板6の少なくとも一 方の固定を確実なものとするために、それらの基板3。 6を位置規制する機構を備えてもよい。 [0032]
- 【発明の効果】本発明の液晶表示素子の製造方法によれ ば、以上のように上基板と液晶材料又は接着剤を接触さ 40 【符号の説明】 せた後位置合わせを行うようにしたので、位置合わせ後 の移動時の状態変化が少なくかつ移動距離が短いため、 下基板と上基板の貼り合わせ時の位置ずれを無くして画 像むら不良を無くすことができる。
- 【0033】また、両基板を所定間隔位置まで接近移動 させて予備位置合わせを行った後上記のように位置合わ せすると、上記と同様の効果を奏するとともに、予備位

- 置決めによって位置決め時の移動量が少なくなるため接 着剤の液晶材料への溶け込みを抑制できる。
- 【0034】また、上基板と液晶材料又は接着剤を接触 させる工程時に、上基板を接着剤との間に微小隙間が生 じる位置に維持すると、接着剤にて上基板と下基板がく っついてしまって位置合わせができなくなる恐れを無く すことができる。
- 【0035】また、下基板と真空吸着する機構との間に 弾性体を介装すると、下基板が上基板の形状にならって またその場合に下基板と上基板を貼り合わせた後、下基 板の吸着を解除すると、上基板の吸着機構に両基板が固 定されることにより、両基板の平面度を高精度に得るこ とができる。
- 【0036】また、下基板と上基板を貼り合わせた後下 基板の吸着を解除し、真空容器内の圧力を大気間放した 後、UV硬化接着剤により仮止めを行うと、貼り合わせ 後上基板と下基板がずれるのを確実に防止できる。
- 【0037】また、下基板と上基板を貼り合わせ、UV 硬化接着剤により仮止めを行った後、下基板の吸着を解 除し、真空容器内の圧力を大気開放すると、貼り合わせ 後上基板と下基板がずれるのを確実に防止できる。
 - 【0038】また、上基板と下基板の少なくとも一方の 位置を規制機構にて規制すると、上基板又は下基板の固 定を確実なものにできる。 【図面の簡単を説明】
 - 【図1】本発明の液晶表示素子の製造方法における第1 の実施形態の工程を示す模式的断面図である。
- 【図2】図1の後続工程を示す模式的断面図である。 がずれないようにするため、下基板3と上基板6を貼り 30 【図3】本発明の液晶表示素子の製造方法における第2
 - の実施形態の工程を示す模式的断面図である。 【図4】図3の後続工程を示す模式的断面図である。
 - 【図5】液晶表示素子の概略構成を示す模式的に示す断 面図である。
 - 【図6】液晶表示素子の液晶滴下工法による製造工程を 示す模式的断面図である。
 - 【図7】従来例の液晶表示素子の製造工程を示す模式的 断面図である。
 - 【図8】図7の後続工程を示す模式的断面図である。
 - 接着割
 - 2 液晶材料
 - 3 下基板
 - 5 吸着機構
 - 6 上基板
 - 7 吸着機構
 - 8 紫外線





11/9/2009, EAST Version: 2.4.1.1

フロントページの続き

(72)発明者 井上 進 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

(72) 発明者 炭田 社朗 大阪府門真市大学門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (72) 発明者 酒井 直人 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

(72) 発明者 松川 秀樹 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

Fターム(参考) 2H088 FA04 FA09 FA16 MA17 MA20 2H089 NA22 NA44 NA48 NA51 QA12 QA14